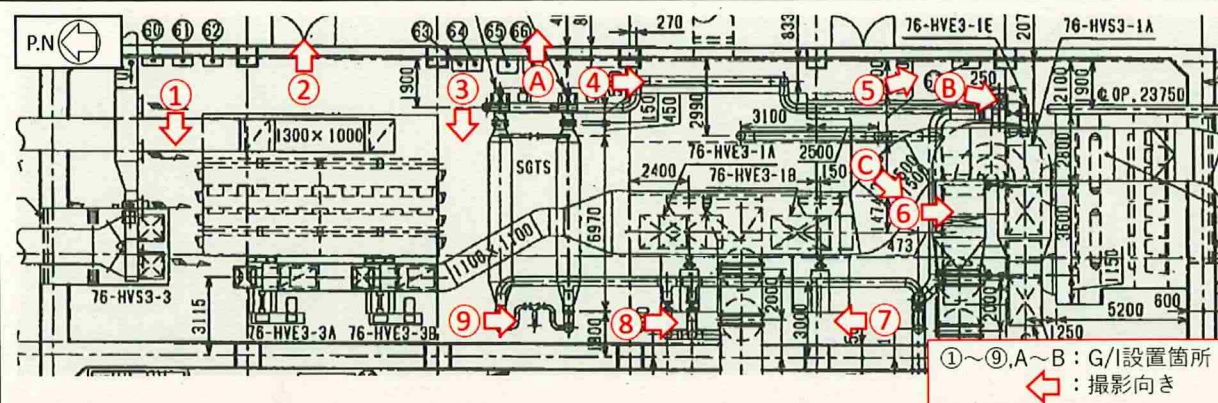


3号機 SGTS 室 測定結果

1. ガンマイメジャー（以下、G/I）によるオーバーレイ画像

図1 G/I 測定箇所



測定箇所①

測定日：2020年9月30日



測定箇所②

測定日：2020年9月28日



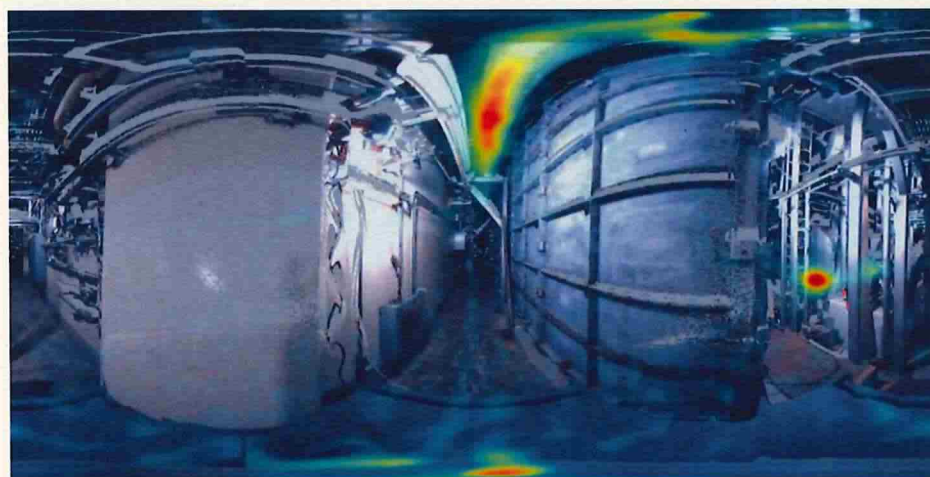
測定箇所③

測定日：2020年9月24日



測定箇所④

測定日：2020年9月23日



測定箇所⑤

測定日：2020年9月17日



測定箇所⑥

測定日：2020年9月18日



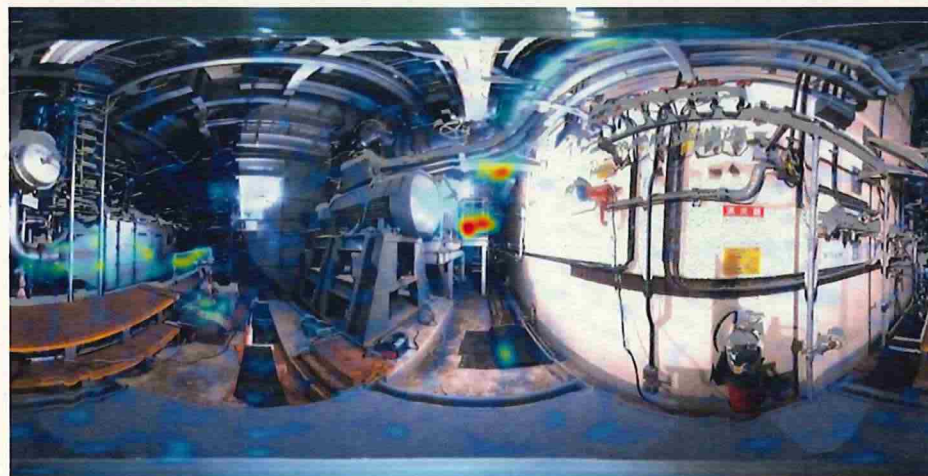
測定箇所⑦

測定日：2020年9月23日



測定箇所⑧

測定日：2020年9月29日



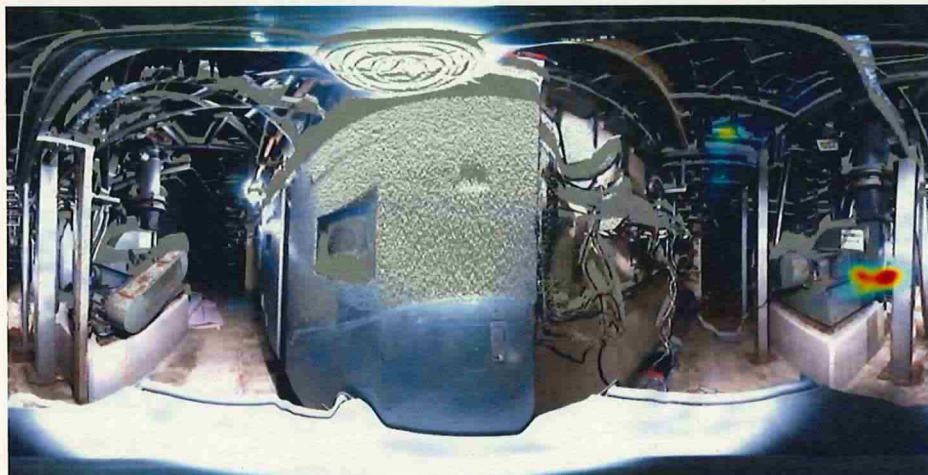
測定箇所⑨

測定日：2020年9月29日



測定箇所 A

測定日：2020年10月2日



測定箇所 B

測定日：2020年10月5日



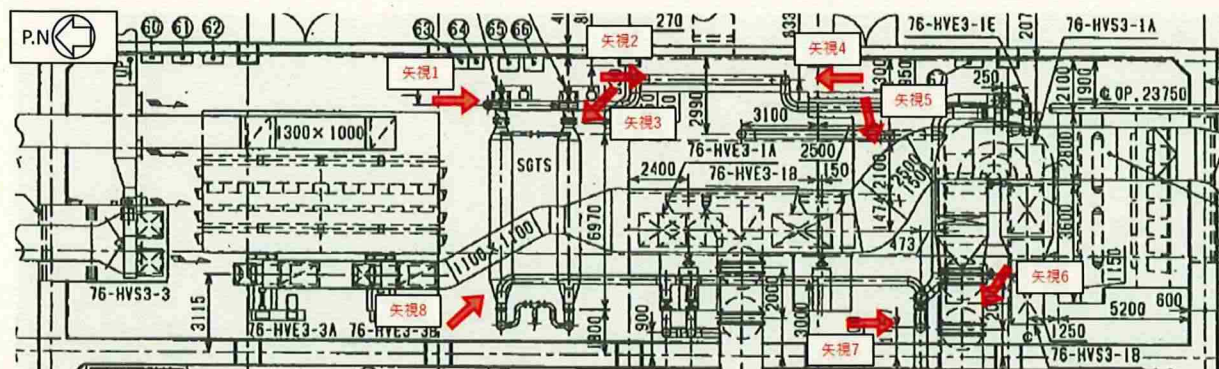
測定箇所 C

測定日：2020 年 10 月 6 日



2. 各オーバーレイから見えるホットスポットの線量率

図 2 矢視図



矢視 1



表面線量率 : 2.5mSv/h

測定器 : ICW

参照オーバーレイ : 測定箇所①、③

矢視 2









表面線量率 (mSv/h)

① : 3.3 ② : 3.7 ③ : 3.3

測定器

テレテクター

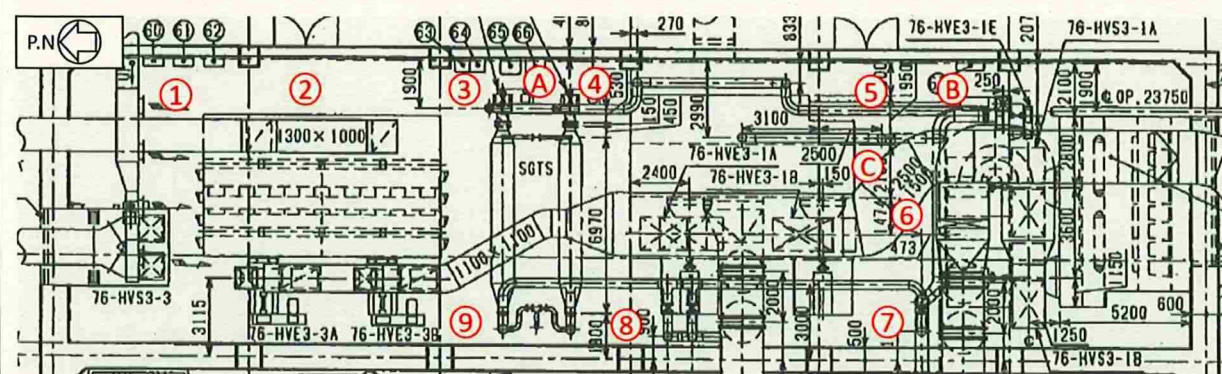
参照オーバーレイ : 測定箇所④

矢視 3		矢視 4	
			
表面線量率：4.5mSv/h	測定器：ICW	表面線量率：4.2mSv/h	測定器：テレテクター
参照オーバーレイ：測定箇所④		参照オーバーレイ：測定箇所⑤、B	
矢視 5		矢視 6	
			
表面線量率 (mSv/h) ①：2.5 ②：6.5 ③：6.3	測定器 テレテクター	表面線量率 (mSv/h) 上部：8.0 下部：0.5	測定器：ICW
参照オーバーレイ：測定箇所⑤、⑥、C		参照オーバーレイ：測定箇所⑥、⑦、⑧	
矢視 7		矢視 8	
			
表面線量率：8.0mSv/h	測定器：ICW	表面線量率：8.0mSv/h	測定器：ICW
参照オーバーレイ：測定箇所⑥、⑦、⑧		参照オーバーレイ：測定箇所⑨	

3. 線量率測定結果

3-1 空間線量率

図3 測定箇所

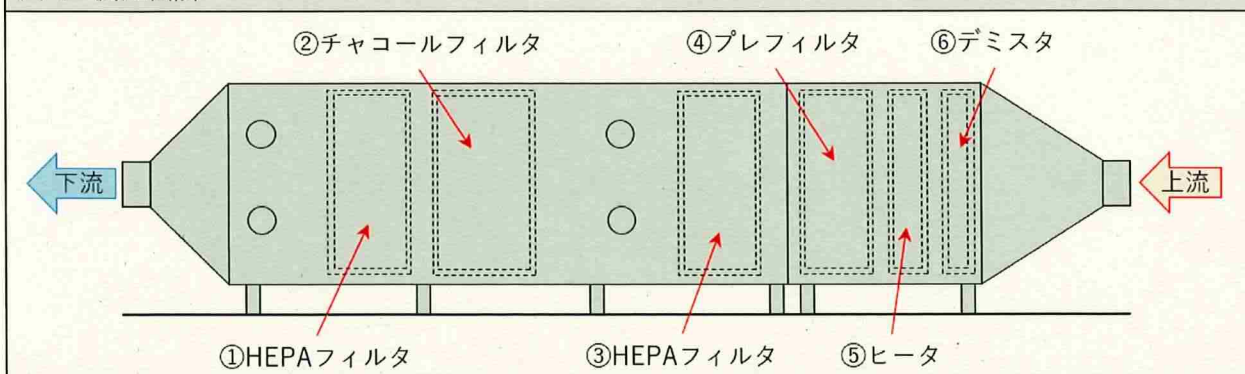


No.	測定箇所	γ 線量率 (mSv/h)	測定日	備考
①	床上 1m	0.080	2020 年 9 月 30 日	G/I 測定箇所
②	床上 1m	0.10	2020 年 9 月 28 日	G/I 測定箇所
③	床上 1m	0.20	2020 年 9 月 24 日	G/I 測定箇所
④	床上 1m	0.50	2020 年 9 月 23 日	G/I 測定箇所
⑤	床上 1m	0.40	2020 年 9 月 17 日	G/I 測定箇所
⑥	床上 1m	0.60	2020 年 9 月 18 日	G/I 測定箇所
⑦	床上 1m	0.50	2020 年 9 月 23 日	G/I 測定箇所
⑧	床上 1m	0.25	2020 年 9 月 29 日	G/I 測定箇所
⑨	床上 1m	0.55	2020 年 9 月 29 日	G/I 測定箇所
A	床上 1m	0.40	2020 年 10 月 2 日	G/I 測定箇所
B	床上 1m	0.25	2020 年 10 月 5 日	G/I 測定箇所
C	床上 1m	0.55	2020 年 10 月 6 日	G/I 測定箇所

※ 詳細は 2020 年 9 月 17 日～10 月 6 日の放射線管理記録を参照

3-2 フィルタトレイン線量率

図4 測定箇所

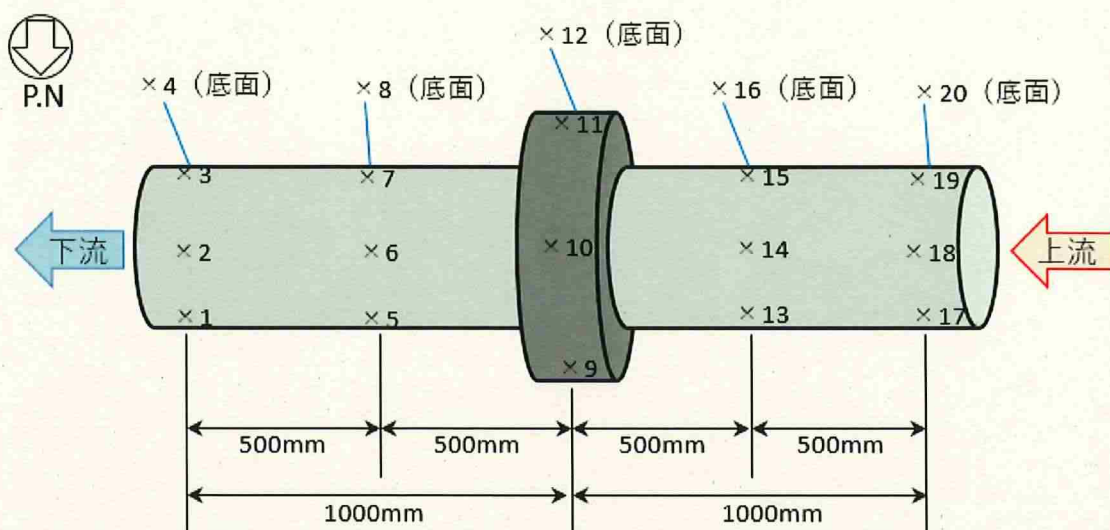


No.	表面線量当量率 (mSv/h)		測定場所	測定日
	γ 線	$\beta + \gamma$ 線		
①-1 (A系)	1.0	4.0	上流側表面	2020年11月9日
②-4 (A系)	0.50	1.0	フィルタ正面	2020年11月9日
③-1 (A系)	4.0	4.0	上流側表面	2020年11月9日
④-1 (A系)	2.0	2.5	上流側表面	2020年11月9日
④-2 (A系)	2.0	2.0	下流側表面	2020年11月9日
⑤-1 (A系)	0.40	1.2	機器表面	2020年11月9日
⑥-1 (A系)	1.2	3.5	フィルタ側面	2020年11月9日
①-1 (B系)	1.8	2.5	上流側表面	2020年11月16日
②-1 (B系)	0.90	0.90	最上段上流	2020年11月16日
②-4 (B系)	3.0	5.5	フィルタ正面	2020年11月16日
③-1 (B系)	4.0	12	上流側表面	2020年11月16日
④-1 (B系)	0.70	2.5	上流側表面	2020年11月16日
④-2 (B系)	0.50	2.0	下流側表面	2020年11月16日
⑤-1 (B系)	0.50	0.80	機器表面	2020年11月16日
⑥-1 (B系)	2.2	25	フィルタ側面	2020年11月16日

※ 詳細は2020年11月9日の放射線管理記録を参照

3-3 ラプチャディスク表面線量当量率

図5 ラプチャディスク測定位置（平面図）



No.	γ 線 (mSv/h)	測定箇所	使用測定器
×1	26	配管側面（北）	テレテクター
×2	32	配管上面	テレテクター
×3	9.0	配管側面（南）	テレテクター
×4	18	配管底面	テレテクター
×5	10	配管側面（北）	ICW
×6	30	配管上面	ICW
×7	15	配管側面（南）	ICW
×8	30	配管底面	ICW
×9	2.5	ラプチャディスク側面（北）	ICW
×10	5.0	ラプチャディスク上面	ICW
×11	2.5	ラプチャディスク側面（南）	ICW
×12	2.0	ラプチャディスク底面	ICW
×13	6.0	配管側面（北）	ICW
×14	5.0	配管上面	ICW
×15	6.0	配管側面（南）	ICW
×16	6.0	配管底面	ICW
×17	7.0	配管側面（北）	ICW
×18	9.0	配管上面	ICW
×19	8.0	配管側面（南）	ICW
×20	7.0	配管底面	ICW

※詳細は2020年9月30日の放射線管理記録を参照

4. スミア測定結果

4-1 床面スミア測定

図 6 スミア採取箇所（床面）

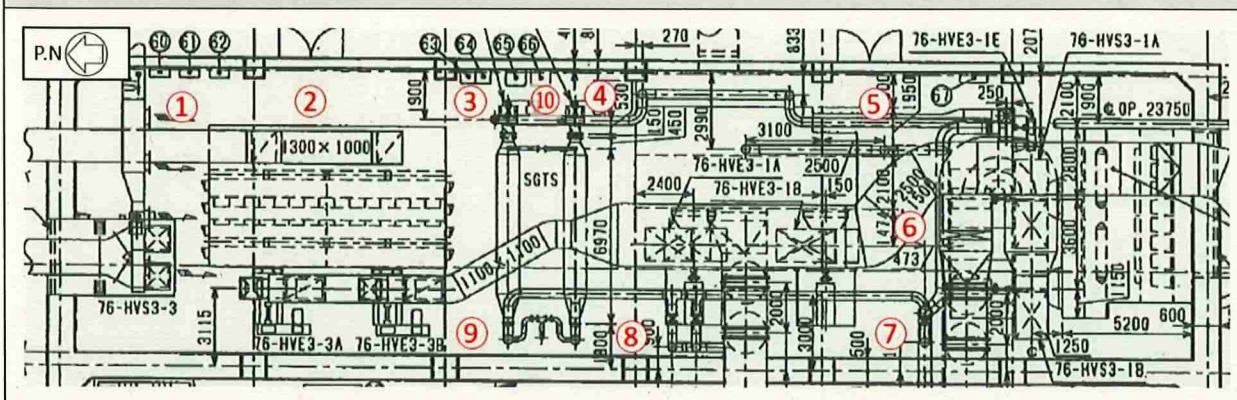


表 1 スミア測定結果（β）

スミア No.	GROSS (cpm)	※ (Bq/cm ²)	採取効率	採取箇所
①	20000	3.0E+02	0.1	G/I 測定箇所①（床面）
②	30000	4.5E+02	0.1	G/I 測定箇所②（床面）
③	30000	4.5E+02	0.1	G/I 測定箇所③（床面）
④	25000	3.7E+02	0.1	G/I 測定箇所④（床面）
⑤	20000	3.0E+02	0.1	G/I 測定箇所⑤（床面）
⑥	60000	9.0E+02	0.1	G/I 測定箇所⑥（床面）
⑦	60000	9.0E+02	0.1	G/I 測定箇所⑦（床面）
⑧	30000	4.5E+02	0.1	G/I 測定箇所⑧（床面）
⑨	65000	9.7E+02	0.1	G/I 測定箇所⑨（床面）
⑩	20000	3.0E+02	0.1	G/I 測定箇所 A（床面）

※ 採取効率が 0.1 の場合は表面汚染密度を 5 倍で補正する。

※ 詳細は 2020 年 10 月 2 日の放射線管理記録を参照

4-2 フィルタトレイン扉表面スミア測定

図7 スミア採取箇所（フィルタトレイン）

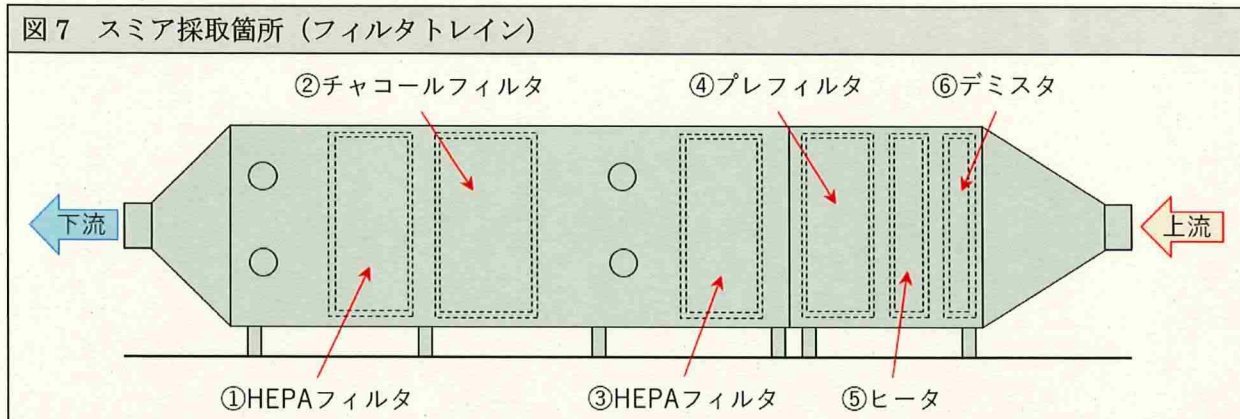


表2 スミア測定結果（α）

スミア No.	GROSS (cpm)	※ (Bq/cm ²)	採取効率	採取箇所
①-1 (A系)	0	LTD	0.1	上流
②-1 (A系)	0	LTD	0.1	最上段上流
②-2 (A系)	0	LTD	0.1	最上段下流
②-3 (A系)	0	LTD	0.1	最下段上流
②-4 (A系)	0	LTD	0.1	最下段下流
③-1 (A系)	0	LTD	0.1	上流
④-1 (A系)	0	LTD	0.1	上流
④-2 (A系)	0	LTD	0.1	下流
⑥-1 (A系)	0	LTD	0.1	上流
⑥-2 (A系)	0	LTD	0.1	下流
①-1 (B系)	0	LTD	0.1	上流
②-1 (B系)	0	LTD	0.1	最上段上流
②-2 (B系)	0	LTD	0.1	最上段下流
②-3 (B系)	0	LTD	0.1	最下段上流
②-4 (B系)	0	LTD	0.1	最下段下流
③-1 (B系)	0	LTD	0.1	上流
④-1 (B系)	0	LTD	0.1	上流
④-2 (B系)	0	LTD	0.1	下流
⑤-1 (B系)	0	LTD	0.1	機器表面
⑥-1 (B系)	0	LTD	0.1	上流
⑥-2 (B系)	0	LTD	0.1	下流

※ 詳細は2020年11月9日、2020年11月16日の放射線管理記録を参照

表 3 スミア測定結果 (β)

スミア No.	GROSS (cpm)	※ (Bq/cm ²)	採取効率	採取箇所
①-1 (A 系)	1000	7.0E+00	0.1	上流
②-1 (A 系)	700	2.8E+00	0.1	最上段上流
②-2 (A 系)	700	2.8E+00	0.1	最上段下流
②-3 (A 系)	700	2.8E+00	0.1	最下段上流
②-4 (A 系)	600	LTD	0.1	最下段下流
③-1 (A 系)	2500	2.8E+01	0.1	上流
④-1 (A 系)	3300	3.9E+01	0.1	上流
④-2 (A 系)	1000	7.0E+00	0.1	下流
⑥-1 (A 系)	23000	3.1E+02	0.1	上流
⑥-2 (A 系)	3500	4.2E+01	0.1	下流
①-1 (B 系)	10000	1.3E+02	0.1	上流
②-1 (B 系)	2000	2.1E+01	0.1	最上段上流
②-2 (B 系)	3000	3.5E+01	0.1	最上段下流
②-3 (B 系)	4000	4.9E+01	0.1	最下段上流
②-4 (B 系)	5000	6.3E+01	0.1	最下段下流
③-1 (B 系)	10000	1.3E+02	0.1	上流
④-1 (B 系)	5000	6.3E+01	0.1	上流
④-2 (B 系)	3000	3.5E+01	0.1	下流
⑤-1 (B 系)	6000	7.6E+01	0.1	機器表面
⑥-1 (B 系)	62000	8.5E+02	0.1	上流
⑥-2 (B 系)	7000	9.0E+01	0.1	下流

※ 採取効率が 0.1 の場合は表面汚染密度を 5 倍で補正する。

※ 詳細は 2020 年 11 月 9 日、2020 年 11 月 16 日の放射線管理記録を参照

表 4 スミア表面線量当量率

スミア No.	スミア表面線量当量率 (mSv/h)		採取箇所
	γ 線	$\beta + \gamma$ 線	
①-1 (A 系)	0.010	0.010	上流
②-1 (A 系)	0.0050	0.005	最上段上流
②-2 (A 系)	0.0050	0.005	最上段下流
②-3 (A 系)	0.0050	0.005	最下段上流
②-4 (A 系)	0.0050	0.005	最下段下流
③-1 (A 系)	0.030	0.030	上流
④-1 (A 系)	0.040	0.040	上流
④-2 (A 系)	0.0050	0.005	下流
⑥-1 (A 系)	0.040	0.40	上流
⑥-2 (A 系)	0.060	0.060	下流
①-1 (B 系)	0.0050	0.060	上流
②-1 (B 系)	0.0050	0.010	最上段上流
②-2 (B 系)	0.0050	0.005	最上段下流
②-3 (B 系)	0.0050	0.030	最下段上流
②-4 (B 系)	0.0050	0.015	最下段下流
③-1 (B 系)	0.0060	0.040	上流
④-1 (B 系)	0.0050	0.020	上流
④-2 (B 系)	0.0070	0.15	下流
⑤-1 (B 系)	0.0060	0.030	機器表面
⑥-1 (B 系)	0.0080	0.30	上流
⑥-2 (B 系)	0.0050	0.040	下流

※ 詳細は 2020 年 11 月 9 日、2020 年 11 月 16 日の放射線管理記録を参照

4-3 ラプチャディスク スミア測定

図 8 測定箇所

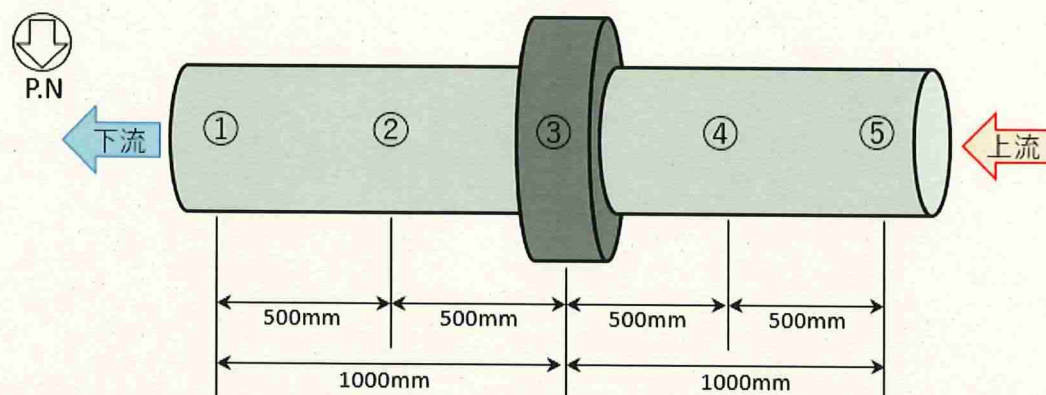


表 5 スミア測定結果 (β)

No.	GROSS (cpm)	※ (Bq/cm ²)	採取効率	採取箇所
①	>100k	>1.5E+03	0.1	配管
②	>100k	>1.5E+03	0.1	配管
③	85000	1.3E+03	0.1	ラプチャディスク
④	45000	6.7E+02	0.1	配管
⑤	25000	3.7E+02	0.1	配管

※ 採取効率が 0.1 の場合は表面汚染密度を 5 倍で補正する。

※ 詳細は 2020 年 9 月 30 日の放射線管理記録を参照